

基板材質	UVグレードフューズドシリカ、またはBK7
平面度	BK7 : $\lambda/4$ (P-V@633 nm、コーティング前において) フューズドシリカ : $\lambda/10$ (P-V@633 nm、コーティング前において)
寸法公差	+ 0.00 mm、- 0.25 mm
角度公差	± 3 分
面取り	0.35 mm、45°標準
減反射コーティング	単波長AR : $R \leq 0.25\%$ /1面 広帯域AR : $R_{avg} \leq 0.50\%$ /1面
コーティング	電子ビーム誘電体多層膜
表面品位	BK7 : 20-10、CVIレーザークオリティ フューズドシリカ : 10-5、CVIレーザークオリティ
密着性と耐久性	MIL-C-675Cによる。溶剤による非溶解性のテスト
有効寸法	中心の85%以上
損傷しきい値	10 J/cm ² 、20 ns、20 Hz (@1064 nm) 1 MW/cm ² (CW@1064 nm)

広帯域の高エネルギー用90°リフレクターとして使用

UVビームの伝送、ビームの抜き取り、可変の遅延ラインに

底面には高エネルギー用ARおよび広帯域ARコーティングを施す事が可能

他の波長、寸法に製品にも対応可能

3軸プリズムマウントをご用意

P90直角ベンディングプリズムは、像を反転させ方向を90°変えるために、斜辺における内部全反射(TIR)を利用しています。入射面からの戻り光をゼロ近くまで減少させ、透過率を最大にするため、後述のRAPシリーズ直角プリズムの2つの底辺に減反射コーティングを施した形となっています。12.7 mmから25.4 mmのBK7およびUVグレードフューズドシリカの標準基板は常に在庫されていますが、RAPシリーズのプリズムから製作することも可能です。内部反射は波長とは無関係であるため、金属ミラーでは吸収が大きく、誘電体ミラーでは帯域幅が十分ではない高エネルギーの90°の折り曲げに使用することができます。

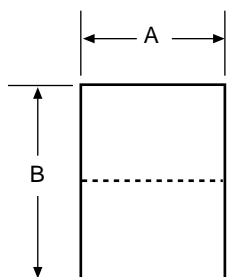
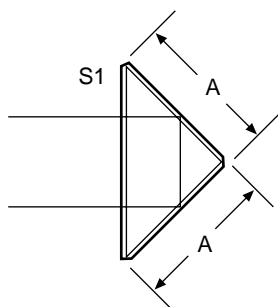
ズドシリカの標準基板は常に在庫されていますが、RAPシリーズのプリズムから製作することも可能です。内部反射は波長とは無関係であるため、金属ミラーでは吸収が大きく、誘電体ミラーでは帯域幅が十分ではない高エネルギーの90°の折り曲げに使用することができます。

ご注文方法

P90-100-532-C

製品コード	P90				
寸法コード	A寸法(mm、理論上の頂点まで)				
050	12.7				
090	25.0				
100	25.4				
減反射コーティングの波長 (nm、S1およびS2)					
248	308	425-675	670-1064	1319	
248-355	355	488/514	800	1550	
266	355-532	532	1064		
材質コード	材質				
C	BK7				
UV	UVグレードフューズドシリカ				

180 °フォールディングプリズム



広帯域の高エネルギー用
180 °リフレクターとして使用

UVビームの伝送、ビームの抜き取り、
可変の遅延ラインに

斜辺には高エネルギー用ARおよび広帯域
ARコーティングを施す事が可能

他の波長、寸法に製品にも対応可能

3軸プリズムマウントをご用意

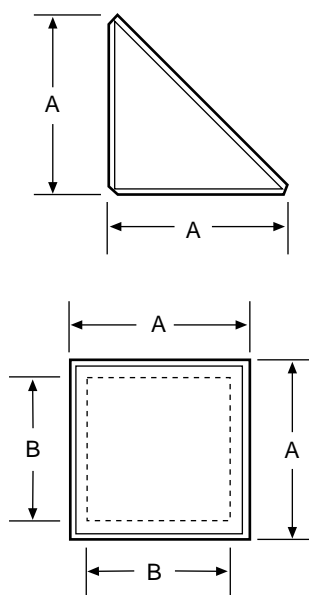
基板材質	UVグレード フューズドシリカ、またはBK7
平面度	BK7 : $\lambda/4$ (P-V@633 nm、コーティング前において) フューズドシリカ : $\lambda/10$ (P-V@633 nm、コーティング前において)
寸法公差	+ 0.00 mm、 - 0.25 mm
角度公差	± 3 分
面取り	0.35 mm、 45 °標準
減反射コーティング	単波長AR : $R \leq 0.25\% / 1$ 面 広帯域AR : $R_{avg} \leq 0.50\% / 1$ 面
コーティング	電子ビーム誘電体多層膜
表面品位	BK7 : 20-10、CVIレーザークオリティ フューズドシリカ : 10-5、CVIレーザークオリティ
密着性と耐久性	MIL-C-675Cによる。溶剤による非溶解性のテスト
有効寸法	中心の85%以上
損傷しきい値	10 J/cm ² 、 20 ns、 20 Hz (@1064 nm) 1 MW/cm ² (CW@1064 nm)

P180フォールディングプリズムは、入射した光と平行な180 °方向に折り返すために、直角を挟む2辺における内部全反射(TIR)を利用してします。入射面からの戻り光をゼロ近くまで減少させ、透過率を最大にするため、後述のRAPシリーズ直角プリズムの斜辺に減反射コーティングを施した形となっています。12.7 mmから25.4 mmのBK7および

UVグレード フューズドシリカの標準基板は常に在庫されていますが、RAPシリーズのプリズムから製作することも可能です。内面反射は波長とは無関係であるため、金属ミラーでは吸収が大きく、誘電体ミラーでは帯域幅が十分ではない高エネルギーの180 °の折り曲げに使用することができます。

ご注文方法

製品コード	P180-050-266-UV			
P180				
寸法コード	A寸法(mm、理論上の頂点まで)			
050	12.7			
090	25.0			
100	25.4			
減反射コーティングの波長(nm、S1およびS2)				
248	308	425-675	670-1064	1319
248-355	355	488/514	800	1550
266	355-532	532	1064	
材質コード	材質			
C	BK7			
UV	UVグレードフューズドシリカ			



基板材質	Suprasil 1、UVグレードフューズドシリカ、またはBK7
表面品位	下表を参照
寸法公差	+ 0.00 mm、- 0.25 mm
角度交差	± 3分
面取り	0.35 mm、45°標準

直角プリズム(RAPシリーズ製品)は、像の回転、光の方向転換、そして偏光および無偏光キューブビームスプリッターの基盤として最も一般的に使用されています。45-45-90°のシンプルなデザインと高品質の研磨により、高エネルギーの90°の折り曲げまたは180°の

折り返しに使用することができます。このプリズムには透過率を高めるための減反射コーティング、または外面反射ミラーとして使用するための金属コーティングを施す事ができます。

光学遅延ラインに
潜望鏡やレンジファインダーに
回転ミラーの基盤として
容易で安定したマウントが可能

直角プリズム、無コート

製品番号	寸法 A (mm、理論上の頂点まで)	平面度	表面品位	有効寸法 B (mm)	材質
Suprasil 1					
RAP-050-SS	12.7	/10	10-5	10.8	Suprasil 1
RAP-090-SS	25.0	/10	10-5	21.0	Suprasil 1
RAP-100-SS	25.4	/10	10-5	21.6	Suprasil 1
フューズドシリカ					
RAP-050-UV	12.7	/10	10-5	10.8	フューズドシリカ
RAP-090-UV	25.0	/10	10-5	21.0	フューズドシリカ
RAP-100-UV	25.4	/10	10-5	21.6	フューズドシリカ
RAP-150-UV	38.1	/10	10-5	32.4	フューズドシリカ
RAP-200-UV	50.8	/10	10-5	43.2	フューズドシリカ
BK7					
RAP-020-C	5.0	/4	20-10	3.0	BK7
RAP-024-C	6.0	/4	20-10	3.9	BK7
RAP-032-C	8.0	/4	20-10	5.6	BK7
RAP-040-C	10.0	/4	20-10	8.0	BK7
RAP-048-C	12.0	/4	20-10	10.2	BK7
RAP-050-C	12.7	/4	20-10	10.8	BK7
RAP-060-C	15.0	/4	20-10	12.8	BK7
RAP-080-C	20.0	/4	20-10	17.0	BK7
RAP-090-C	25.0	/4	20-10	21.0	BK7
RAP-100-C	25.4	/4	20-10	21.6	BK7
RAP-150-C	38.1	/4	20-10	32.4	BK7
RAP-200-C	50.8	/4	20-10	43.2	BK7

ダブルプリズム

ウィンドウ

プリズム

球面レンズ

ミラー

スプリッター

波長板

偏光光学素子

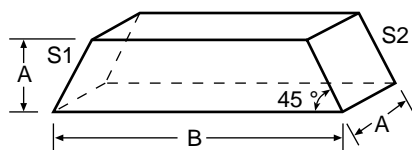
超短パルス用光学素子

エタロン

フィルター

干渉計用アクセサリ

マウント



基板材質	UVグレードフューズドシリカ、またはBK7
表面品位	/4 (@633 nm、コーティング前において)
表面品位	10-5、CVIレーザークオリティ (第1面、第2面、および底面) 残りの面は標準研磨
寸法公差	+ 0.00 mm、- 0.25 mm
角度公差	± 3分
面取り	0.35 mm、45°標準
有効寸法	中心の85%以上

像の反転に

ビームの折り返し用プリズムに

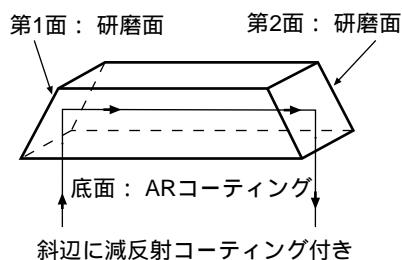
CVIメレスグリオの全ての低損失、
高エネルギー用ARおよび広帯域ARコーティングを施す事が可能

他の寸法や波長にも対応可能

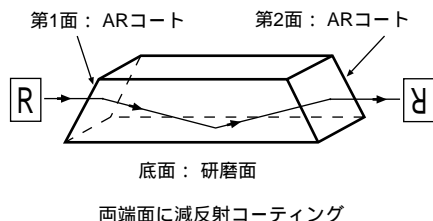
ビーム折返し用ダブルプリズム、斜辺(底面)にARコーティング

製品番号	寸法 A (mm)	寸法 B* (mm)	ARコーティングの波長範囲 (nm)	反射率 (%、0°入射)
フューズドシリカ				
DP-040-UV-248-355-HYP	10.0	42.0	248 ~ 355	R _{avg} < 0.5 %
DP-060-UV-248-355-HYP	15.0	63.0	248 ~ 355	R _{avg} < 0.5 %
DP-100-UV-248-355-HYP	25.4	106.7	248 ~ 355	R _{avg} < 0.5 %
BK7				
DP-024-C-450-694-HYP	6.0	25.0	450 ~ 694	R _{avg} < 0.5 %
DP-024-C-532-HYP	6.0	25.0	532	R < 0.25 %
DP-024-C-1064-HYP	6.0	25.0	1064	R < 0.25 %
DP-040-C-450-694-HYP	10.0	42.0	450 ~ 694	R _{avg} < 0.5 %
DP-040-C-532-HYP	10.0	42.0	532	R < 0.25 %
DP-040-C-1064-HYP	10.0	42.0	1064	R < 0.25 %
DP-050-C-450-694-HYP	12.7	53.3	450 ~ 694	R _{avg} < 0.5 %
DP-050-C-532-HYP	12.7	53.3	532	R < 0.25 %
DP-050-C-1064-HYP	12.7	53.3	1064	R < 0.25 %
DP-100-C-450-694-HYP	25.4	106.7	450 ~ 694	R _{avg} < 0.5 %
DP-100-C-532-HYP	25.4	106.7	532	R < 0.25 %
DP-100-C-1064-HYP	25.4	106.7	1064	R < 0.25 %

ビーム折返し用ダブルプリズム、斜辺(底面)にARコーティング



像反転用ダブルプリズム



像反転用ダブルプリズム、両端面にARコーティング

製品番号	寸法 A (mm)	寸法 B* (mm)	ARコーティングの波長範囲 (nm)	反射率 (%/1面、45°入射)
フューズドシリカ				
DP-040-UV-248-355-ENDS	10.0	42.0	248 ~ 355	R _{avg} < 0.75 %
DP-060-UV-248-355-ENDS	15.0	63.0	248 ~ 355	R _{avg} < 0.75 %
DP-100-UV-248-355-ENDS	25.4	106.7	248 ~ 355	R _{avg} < 0.75 %
BK7				
DP-024-C-450-694-ENDS	6.0	25.0	450 ~ 694	R _{avg} < 0.75 %
DP-024-C-532-ENDS	6.0	25.0	532	R < 0.5 %
DP-024-C-1064-ENDS	6.0	25.0	1064	R < 0.5 %
DP-040-C-450-694-ENDS	10.0	42.0	450 ~ 694	R _{avg} < 0.75 %
DP-040-C-532-ENDS	10.0	42.0	532	R < 0.5 %
DP-040-C-1064-ENDS	10.0	42.0	1064	R < 0.5 %
DP-050-C-450-694-ENDS	12.7	53.3	450 ~ 694	R _{avg} < 0.75 %
DP-050-C-532-ENDS	12.7	53.3	532	R < 0.5 %
DP-050-C-1064-ENDS	12.7	53.3	1064	R < 0.5 %
DP-100-C-450-694-ENDS	25.4	106.7	450 ~ 694	R _{avg} < 0.75 %
DP-100-C-532-ENDS	25.4	106.7	532	R < 0.5 %
DP-100-C-1064-ENDS	25.4	106.7	1064	R < 0.5 %

* 寸法は、理論上の頂点までの値

ポロプリズム

ウィンドウ

プリズム

球面レンズ

ミラー

スプリッター

波長板

偏光光学素子

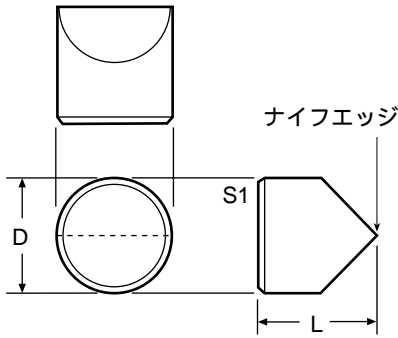
超短パルス用光学素子

エタロン

フィルター

干渉計用アクセサリ

マウント

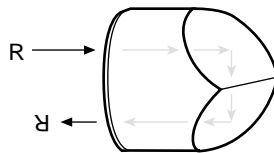
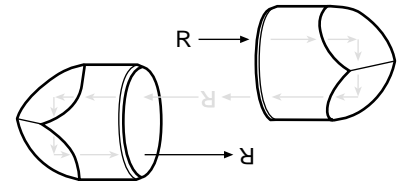


基板材質	UVグレードフューズドシリカ、またはBK7
平面度	/10 (@633 nm、コーティング前において)
表面品位	10-5、CVIレーザークオリティ
寸法公差	: + 0.00 mm、 - 0.25 mm
	長さ: ± 0.25 mm
角度公差	≤ 10秒
面取り	0.35 mm、45°標準
ナイフエッジ	≤ 5 μm
有効寸法	直径中心の85%以上
減反射コーティング	単一波長AR: R ≤ 0.25 %
	広帯域AR: R _{avg} ≤ 0.50 %

CVIメスグリオの全ての低損失、高エネルギー用ARおよび広帯域ARコーティングを施す事が可能
他の波長、寸法の製品にも対応可能

その発明者である Ignazio Porro の名前から命名されたポロプリズムは、像の方向を変更するために使用される反射プリズムの一種です。光はプリズムの大きな面に入射され、45°の斜面における2度の内部全反射の後、再び大きな面から出力されます。像はポロプリズム内で180°回転し、入射した位置からプリズムの中心に対して正反対の位置にオフセットされ出射されます。像は2回反射するため、像の左右方向の向きは変化しません。ポロプリズムは、破損を最小に抑え、組み込みを容易にするため円筒形の形状をしています。

ポロプリズムはほとんどの場合ペアで使用され、二重のポロプリズムを形成します。第二のプリズムは、ビームが双方のプリズムを透過できるように配置します。プリズムシステムの作用は、像を180°回転し、元々の方向に平行でありながら位置がずれる点です。この時も、前述のように左右方向の像の向きは変化する事はありません。

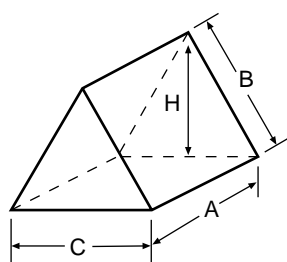


一対のポロプリズムは、反転した像を再び正しい向きに合わせるために小型の望遠鏡に使用され、多くの双眼鏡では対物レンズと接眼レンズの間の長い距離の折り曲げと像の反転の双方に機能します。

ポロプリズム

製品番号	直径 D (mm)	長さ L (mm)	基板材質	ARコーティングの波長範囲 (nm)
PORR-05-C-450-694	12.7	12.7	BK7	450 ~ 694
PORR-05-C-532	12.7	12.7	BK7	532
PORR-05-C-1064	12.7	12.7	BK7	1064
PORR-05-UV-450-694	12.7	12.7	フューズドシリカ	450 ~ 694
PORR-05-UV-532	12.7	12.7	フューズドシリカ	532
PORR-05-UV-1064	12.7	12.7	フューズドシリカ	1064

二等辺ブリュースタープリズム



フェムト秒レーザーのためのGVD
(群速度分散)補正プリズム

2面を光学研磨

170 nmの波長にはSuprasil 1をご用意
P-偏光ビームのロスが非常に小さい
他の寸法や材質にも対応可能

基板材質	Suprasil 1、UVグレードフューズドシリカ、 LaFN28、LaKL21、またはSF10
平面度	/10(@633 nm)
表面品位	Suprasil 1およびUVグレードフューズドシリカ： 10-5、CVIレーザークオリティ LaFN28、LaKL21、およびSF10： 30-10 (MIL-PRF-13830Bによる)
寸法公差	+ 0.00 mm、 - 0.25 mm
角度公差	± 2分
面取り	0.35 mm、45 °標準
有効寸法	中心の85%以上
損傷しきい値	Suprasil 1：15 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm) フューズドシリカ：15 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm)

分散プリズムは、白色光に含まれる波長成分の分離に使用されます。一般的に、先ず光がコリメートされ、その後プリズムにより分散されます。その後、個々のスペクトルはレンズまたは球面ミラーの焦点面に集光されません。

分散プリズムは、レーザービームに含まれる2つの波長の分離に使用されます。通常、分散されたビームは遠くへ行くことにより空間的な分離が十分となります。

分散プリズムは、ビームの入射角度と出射角度が異なっていた場合に、分散面において倍率を呈します。これは、1方向に対するビームのアナモルフィック的な拡大または縮小に便利であり、非対称ビームプロファイルの整形または生成に使用されます。

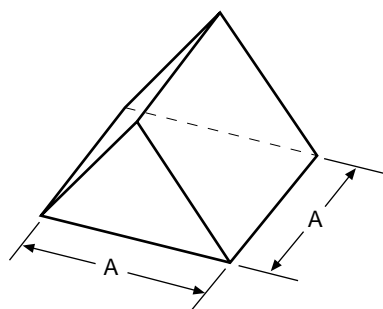
このプリズムの使用方法に関する詳細については、「分散プリズムの使用について」をご参照ください。

LaFN28、およびLaKL21の硝材を使用した製品については、在庫状況をお問合せください。

二等辺ブリュースタープリズム

製品番号	高さ H (mm)	寸法 A (mm)	寸法 B* (mm)	寸法 C* (mm)	頂角 (°)	材質	屈折率 (@633 nm)
IB-10.5-68.7-SS	10.5	7.9	12.7	14.4	68.7	Suprasil 1	1.45702
IB-15.0-68.7-SS	15.0	12.7	18.2	20.6	68.7	Suprasil 1	1.45702
IB-19.0-68.7-SS	19.0	12.7	23.0	26.0	68.7	Suprasil 1	1.45702
IB-12.4-69.1-UV	12.4	15.0	15.0	17.0	69.1	フューズドシリカ	1.45702
IB-13.0-59.2-LaFN28	13.0	15.0	15.0	14.8	59.2	LaFN28	1.76988
IB-12.8-63.0-LaKL21	12.8	15.0	15.0	15.7	63.0	LaKL21	1.63821
IB-13.0-60.6-SF10	13.0	15.0	15.0	15.1	60.6	SF10	1.72307
IB-21.6-60.6-SF10	21.6	25.0	25.0	25.2	60.6	SF10	1.72307

* 寸法は、理論上の頂点までの値です。



基板材質	BK7、UVグレードフューズドシリカ、F2、またはSF10
平面度	/10(@633 nm)
表面品位	BK7およびUVグレードフューズドシリカ： 10-5、CVIレーザークオリティ F2およびSF10：30-10(MIL-PRF-13830Bによる)
寸法公差	+ 0.00 mm、 - 0.25 mm
角度公差	± 3分
面取り	0.35 mm、45°標準
有効寸法	中心の85%以上
損傷しきい値	BK7：15 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm) フューズドシリカ：15 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm)

3面を光学研磨

/10の平面度、10-5の表面品位
他のサイズにも対応可能

分散プリズムは、白色光に含まれる波長成分の分離に使用されます。一般的に、まず光がコリメートされ、その後プリズムにより分散されます。その後、個々のスペクトルはレンズまたは球面ミラーの焦点面に集光されません。

分散プリズムは、レーザービームに含まれる2つの波長の分離に使用されます。通常、分散されたビームは遠くへ行くことにより空間的な分離が大きくなります。

分散プリズムは、ビームの入射角度と出射角度が異なっていた場合に、分散面において倍率を呈します。これは、1方向に対するビームのアナモルフィック的な拡大または縮小に便利であり、非対称ビームプロファイルの整形または生成に使用されます。

このプリズムの使用方法に関する詳細については、「分散プリズムの使用について」をご参照ください。

等辺長分散プリズム

製品番号	エッジ寸法 A* (mm)	材質	屈折率 (@633 nm)
BK7			
EDP-25.0-C	25.0	BK7	1.51509
EDP-30.0-C	30.0	BK7	1.51509
EDP-35.0-C	35.0	BK7	1.51509
EDP-40.0-C	40.0	BK7	1.51509
EDP-45.0-C	45.0	BK7	1.51509
EDP-50.0-C	50.0	BK7	1.51509
EDP-60.0-C	60.0	BK7	1.51509
F2			
EDP-25.0-F2	25.0	F2	1.61655
EDP-50.0-F2	50.0	F2	1.61655
EDP-60.0-F2	60.0	F2	1.61655
SF10			
EDP-60.0-SF10	60.0	SF10	1.72307
UVグレード フューズドシリカ			
EDP-25.0-UV	25.0	Fused Silica	1.45702
EDP-50.8-UV	50.8	Fused Silica	1.45702

* 寸法は、理論上の頂点までの値です。

ペロンブロカプリズム

ウィンドウ

プリズム

球面レンズ

ミラー

ビームスプリッター

波長板

偏光光学素子

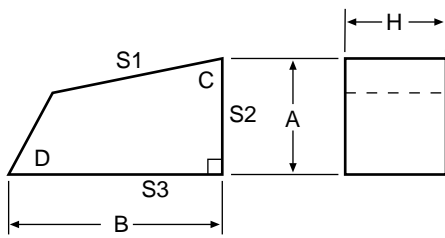
超短パルス光学素子

エタロン

フィルター

干渉計用アクセサリ

マウント



基板材質	Suprasil 1、UVグレードフューズドシリカ、水晶、またはBK7
平面度	/10(@633 nm)
表面品位	20-10、CVIレーザークオリティ(研磨面3面において)
寸法公差	+ 0.00 mm、 - 0.25 mm
角度公差	角度C ± 30分、角度D ± 2 °
面取り	0.35 mm、45 °標準
有効寸法	中心の85%以上
損傷しきい値	15 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm)

ペロンブロカプリズムでは、通常の分散プリズムが頂角の二等分線に沿って半分に分離します。内部全反射によって得られる内部での直角への曲がりを持つ分散プリズムを形成するために、直角プリズムを使用して2つの分散プリズムを接合しています(図1を参照)。

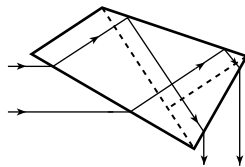


図1

主に、ペロンブロカプリズムを作成するために、あるタイプの分散プリズムに分割する事ができます。通常、ペロンブロカプリズムは二等辺プリースタープリズムを基本にしています。もしP-偏光の光であれば、プリズムによる損失は無いこととなります。

高調波発生結晶からの出力のように、 λ_1 と λ_2 の波長がコリメートビームの中で重なっていると仮定した場合、上記の図1は半分の分散プリズムの第一の入射面で反射する際に、2波長の内の1つの屈折

が最小となる面内にプリズムを回転させることが常に可能であることを示します。

これは、直角プリズムの1つの面が正確に90 °回され、第二の分散プリズムが最小の屈折を呈します。そして、ペロンブロカプリズムからの出射光は始めの方向に対して正確に90 °偏光されます。これは、ペロンブロカプリズムが「定偏角プリズム」と呼ばれる意味を示しています。

通常の分散プリズムでは、長い波長よりも短い波長の屈折が常に大きくなります。ペロンブロカプリズムの場合、屈折の大小は波長の長さではなく、プリズムの向きによって決まります。これは、ハイパワー用のペロンブロカ ビームセパレータを設計する上において考慮されるべき重要なポイントです(図2および図3を参照)。

CVIメレスグリオでは、数多くのサイズと硝材のプリースター角ペロンブロカプリズムをご用意しています。BK7製のプリズムは可視域や近赤外に使用され、最も安価です。UVグレードフューズドシリカ製のペロンブロカプリズムは、240 nmから2000 nmの波長に使用されます。

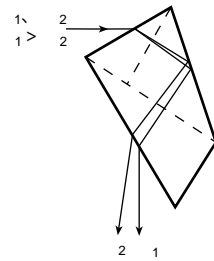


図2

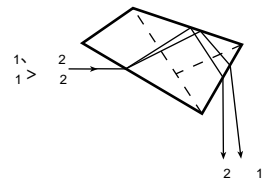


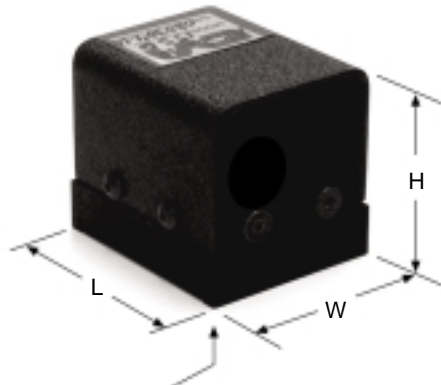
図3

エキシマグレードのプリズムは、180 nmから240 nmの波長域に適します。水晶のペロンブロカプリズムは、50 mJ/cm²より高いエネルギー密度を持つ266 nmのハイパワーQスイッチ パルスレーザーのために特に設計されています。フューズドシリカ製プリズムにおけるこれより上のフリューエンスでは、恐らく自己収束による内部破壊的な損傷を受ける事になります。

ペロンブロカプリズム

製品番号	材質	有効寸法 (mm)	寸法A (mm)	寸法B (mm)	寸法H (mm)	角度C (°)	角度D (°)
PLBC-5.0-79.5-SS	Suprasil 1	5.0	11.0	20.0	6.4	79.5	60
PLBC-10.0-79.5-SS	Suprasil 1	10.0	23.5	40.0	12.7	79.5	60
PLBC-10.0-79.5-UV	フューズドシリカ	10.0	23.5	40.0	12.7	79.5	60
PLBC-10.0-77.2-CQ	水晶	10.0	23.5	40.0	12.7	77.2	60
PLBC-10.0-79.5-C	BK7	10.0	23.5	40.0	12.7	79.5	60

アナモルフィックプリズムペア



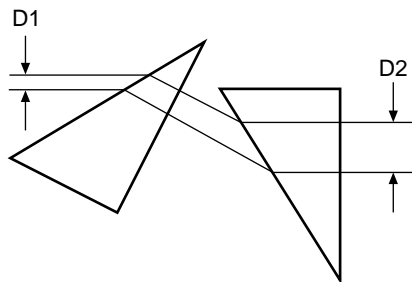
1/4-20タップ(底面の中心に)

ビームの拡大、縮小、または整形に

UVからNIRのダイオード、エキシマ、およびNd:YAGレーザーに最適

CVIメスグリオの全ての低損失ARコーティングを施す事が可能

RoHS対応製品



D1 - 入射ビーム径

D2 - 出射ビーム径

基板材質	SF11(> 425 nmにおいて) UVグレードフューズドシリカ (248 nm < < 1550 nmにおいて)
平面度	/10(P-V@633 nm)
表面品位	20-10、CVIレーザークオリティ
寸法公差	+ 0.00 mm、- 0.25 mm
設計波長	830 nm(SF11の場合) 351 nm(UVグレードフューズドシリカの場合)
ハウジングの材質	黒色アルマイト処理されたアルミニウム製
減反射コーティング	ユーザーにより指定
損傷しきい値	4 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm)

CVIメスグリオのAPおよびAPUVシリーズのアナモルフィックプリズムペアにより、ダイオードやエキシマレーザーの非対称な放射パターンによる楕円ビームの整形を行います。真円に近いビームの場合、一对のウェッジプリズムをアライメントすることにより、適切な倍率を得ることができます。

CVIメスグリオでは、レーザービームの一次的(アナモルフィック)な拡大または縮小のための、アスペクト比が2:1から6:1のマウントされたプリズムペアを在庫しています。マウント用の1/4-20タップ穴が底面の中央に備わっています。

各プリズムの入射側の面は、入射光がP-偏光または無偏光の場合にARコーティングが必要ないプリュスター角近傍にアライメントされています。なお、透過率を最適化するために、ご注文の際には入射光の偏光方向をご指定ください。

マウントされていないプリズムペアは、プリズムの角度と間隔を調整することにより様々な倍率に対応する事が可能です。このタイプのご希望の場合には、製品番号の最後に-UNMを追記してください。

ご注文方法

プリズムの製品番号

ARコーティングの波長 (nm)

248	266	425-675	670-1064	800	1050-1600
248-355	355	488	780	1064	1550

入射光の偏光

S	P	UNP
---	---	-----

マウントされていないプリズムペアの指定

UNM

AP-2X-10.0-780-S-UNM

アナモルフィックプリズムペア

製品番号	倍率	出射側の有効径 (mm)	プリズムの材質	ハウジングの長さ L (mm)	ハウジングの幅 W (mm)	ハウジングの高さ H (mm)
AP-2X-10.0	2X	10.0	SF11	41.4	34.8	36.3
AP-3X-10.0	3X	10.0	SF11	41.4	34.8	36.3
AP-4X-10.0	4X	10.0	SF11	41.4	34.8	36.3
AP-6X-10.0	6X	10.0	SF11	41.4	34.8	36.3
APUV-2X-10.0	2X	10.0	フューズドシリカ	76.2	57.2	47.2
APUV-3X-10.0	3X	10.0	フューズドシリカ	76.2	57.2	47.2
APUV-4X-10.0	4X	10.0	フューズドシリカ	76.2	57.2	47.2